

ナノテクノロジープラットフォーム
研究支援に提供する設備一覧
【微細加工プラットフォーム】

機関名	設備(設備群)名	仕様	備考
産業技術総合研究所	i線露光装置	ニコンテック社製 最大8インチまで各種試料サイズの各種ウエーハに対応可能	
産業技術総合研究所	電子ビーム描画装置	クレステック社製 CABLE 9410TFNA型 4インチまで	
産業技術総合研究所	マスクレス露光装置	ナノシステムソリューション社製	
産業技術総合研究所	プラズマアッシャー	ヤマト社製 PR500型、最大4インチ	
産業技術総合研究所	UVクリーナー	SAMCO社製 UV-1型	
産業技術総合研究所	反応性イオンエッチング装置	SAMCO社製 CCP-RIE 8インチまで各種	
産業技術総合研究所	集束イオンビーム加工観察装置 (FIB) 及び イオンスパッタ(FIB付帯装置)	FB 2100/Ga液体金属イオン源/加速電圧 10~40keV/観察分解能 6nm 及び付帯装置E_1045 イオンスパッタ/ダイオード放電マグネトロン形/対向平行円板。φ18×10mm以下 (FIB)、φ60×20mm以下 (イオンスパッタ)。半導体、化合物半導体、金属、有機物、(危険物・毒物以外)	
産業技術総合研究所	アルゴンミリング装置	伯東社製 3インチまで	
産業技術総合研究所	スパッタ装置	CFS-4EP-LI型 RFマグネトロン・サイドスパッタ φ200×10mm以下各種基板	
産業技術総合研究所	RF・DCスパッタ装置	アルバック社製CS 200型 4カソード 8インチφまでの各種基板	
産業技術総合研究所	真空蒸着装置	エイコーエンジニアリング社製電子ビーム加熱型蒸着装置 100mm角までの各種基板	
産業技術総合研究所	小型真空蒸着装置	KIS 3型 抵抗加熱型真空蒸着 φ100×10mm以下の各種基板	
産業技術総合研究所	デバイスパラメータ評価装置 ワイヤーボンダー	アジレントテクノロジー社製4156C型 測定分解能: 1fA (±10pALenジ) φ150×10mm以下の各種試料 4700D型ワイヤーボンダー/US-TC方式/ワイヤー径: 約Φ25 μm, Au, Al □50×25mm (ヒーターステージを使用しなければφ100×25mm) 以下の各種基板	
産業技術総合研究所	ダイシングソー	Disco社製 DAD522型 6インチφまでのシリコン、ガラス他	
産業技術総合研究所	X線回折装置	リガク社製 Ultima III 試料水平封入X線管型 φ100×9mm以下の各種試料	
産業技術総合研究所	ナノサッチ顕微鏡	SFT 3500型 複合型顕微鏡 φ200mm程度 (面範囲)、54.5mm (高さ範囲) の各種試料	
産業技術総合研究所	走査プローブ顕微鏡	SPM-9700型 各種試料	
産業技術総合研究所	顕微レーザーラマン分光装置	DXR-Raman型 顕微レーザーラマン	
産業技術総合研究所	電界放出形走査電子顕微鏡	日立ハイテクノロジー社製、S4800 II 型 4インチ以下の各種試料	
産業技術総合研究所	プラズマCVD装置	サムコ社製TEOS CVD装置。8インチまで対応。	
産業技術総合研究所	FIB-SEM複合装置	セイコーインスツルメンツ社製X-Vision型	
産業技術総合研究所	多目的エッチング装置	サムコ社製。誘導結合方式。ロードロック式エッチング装置。トルネード型コイル電極採用。シリコンおよび各種金属薄膜、化合物半導体などの高精度の異方性エッチングが可能。最大試料径4インチ、試料温度制御 -25~200℃、高周波出力:1kW,13.56MHz、オートマッチング方式。	
産業技術総合研究所	薄膜エックス線回折装置	Rigaku製 ATX G型。定格出力50kV,300mA。ソーラースリットを用いたインプレーン測定。ゲルマニウム結晶を用いた高分解能測定。	
産業技術総合研究所	ナノプローバー	日立ハイテクノロジー社製N6000型	
産業技術総合研究所	原子層堆積装置	オックスフォードインストルメンツ社製FlexAL型、ミリング機能付	
産業技術総合研究所	短波長レーザー顕微鏡	キーエンス社製 VK-9700型	
産業技術総合研究所	磁気特性測定システム(MPMS)	カンタムデザイン社製	
産業技術総合研究所	二次イオン質量分析装置(D-SIMS)	アルバックファイ社製ADEPT-1010型	
産業技術総合研究所	エックス線光電子分光分析(XPS)装置	KRATOS ANALYTICAL / 榊島津製作所	
産業技術総合研究所	分光エリブソメータ	堀場Jovin-Yvon社製、UVISEL-M200-FUV-FGMS型 入射角度75° / 波長190nm~830nm φ150×20mm以下の各種試料	
産業技術総合研究所	微小部蛍光X線分析装置	SEA 5210A型 微小領域エネルギー分散型XRF □80×35mm以下の各種試料	
産業技術総合研究所	高速昇降温炉	アルバック理工製 Pss/85#/7089_1型 3インチφまで	
産業技術総合研究所	触針式段差計	Alpha-Step IQ型 □150mm以内の各種試料	
産業技術総合研究所	スピコンター	ミカサ製1H-DX2型 6インチまで	
産業技術総合研究所	コンタクトマスクアライナー	MJB4型インチサイズ不定形各種基板	
産業技術総合研究所	低真空走査電子顕微鏡	日立ハイテクノロジー製、型式:S-3500N、電子銃:熱電子放出型Wへアピンフィラメント、加速電圧:0.3~30 kV	
産業技術総合研究所	短波長レーザー顕微鏡	オリンパス製 OLS-4100	